

φ28

GW28

半導体産業用圧力計

Model GW28 Pressure Gauge For Semiconductor Industry

概要

半導体高純度ガス、及び腐食性ガスの雰囲気等の条件下でも優れた性能を発揮します。

気密性・洗浄度に対しても充分考慮して製作されており、半導体プロセス等、特に高純度流体向けに適した圧力計です。

特長

- ・ φ28サイズの小径タイプのため、集積化マウントの省スペース化に貢献できます。
- ・ 接ガス部は、従来のC形ブルドン管に比べ、単純なダイアフラム式であるため、洗浄やガスフラッシングが容易に出来る構造です。
- ・ 従来品（小型ブルドン管式）に対して接ガス部内容積は、約1/2となりガスが滞留するデッドスペース（接ガス部内容積）が大幅に低減されています。

* 圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう常用使用圧力が圧力レンジの30～65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。



グレード一覧表

グレード	BA (Bright Annealing)	EP (Electro Polishing)
接液部材質	SUS316L	SUS316L (接ガス面研磨)
洗浄度	クラス IV (ANSI B40、1M-1979)	0.2 μm以上の パーティクル10個以下
漏れ検査	1.01 × 10 ⁻⁹ Pa · m ³ /s以下	
洗浄	① 洗浄 ② 超音波洗浄 ③ 仕上げ洗浄 ④ N ₂ ガスフラッシング	
作業場所	① 一般作業場所 ② クリーンルーム（クラス10,000） ③ クリーンルーム（クラス100）	
調整検査媒体	N ₂ ガス	
梱包形態	ポリエチレン袋密封	

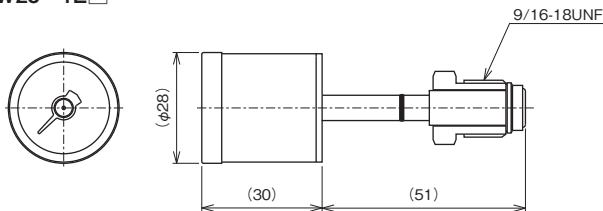
製作仕様

項目	内容
測定流体	気体又は液体
形状	埋込形…  D枠 (中心裏ネジ、ステム)
大きさ	φ28
接続ねじ	9/16-18UNF
材質	ダイアフラム・接続部 SUS316L ケース SUS304 (生地) 内機 SUS製
ケース構造	屋内一般形
溶接方法	アルゴンアーク溶接
圧力レンジ	-0.1~0.2MPa -0.1~0.4MPa -0.1~0.7MPa -0.1~1MPa
許容最大圧力	圧力レンジの1.0倍
使用温度範囲	-5~45℃
精度	±3%F.S.
気密性 (He真空法)	1.01×10^{-9} Pa・m ³ /s以下
洗浄度	EPグレード: 0.2μm以上のパーティクル10個以下 BAグレード: クラス IV (ANSI B40、1M-1979)
質量	約85g

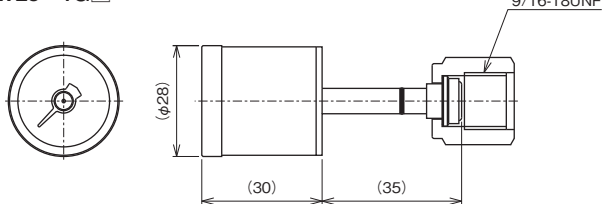
外形寸法

単位: mm

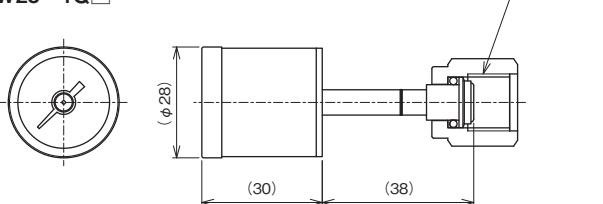
GW28-1E□



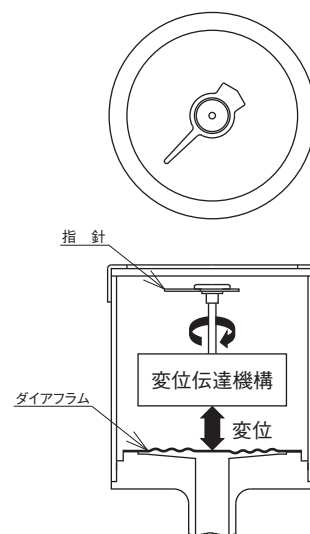
GW28-1G□



GW28-1Q□



構造



形番構成

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo. **GW28** 半導体産業用圧力計

① ② ③ — ④ ⑤ ⑥ ⑦ × × × × × × ×

形番	選択仕様	付加仕様 (オプション)
① 形状	1	D枠 埋込形 (中心裏ネジ、ステム)
② 接続ねじ	E	9/16-18UNF (1/4CVCオスナット)
	G	9/16-18UNF (1/4CVCメスナット)
	Q	9/16-18UNF (1/4UJR™メスナット ピュアリング付)
		その他指定
③ グレード	3	BAグレード
	4	EPグレード
④ 圧力レンジ	1	-0.1~0.2、0.4、0.7、1MPa 連成計
⑤ 精度	0	標準 (±3.0%F.S.)
⑥ 指針	0	標準形
⑦ ガラス	0	標準
⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、強度計算書、立会検査

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。